

## 연수 제안서

연구 분야	고성능 압전 MEMS 개발
연구 과제명	거대압전단결정박막멤스를이용한휴대용지문/정맥인식시스템 개발 (삼성소재기술)
연수 제안 업무	단결정 박막 성장 및 멤스 소자 제작
<p>(연수 내용)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 거대 압전 단결정 박막을 스퍼터링 공정을 이용해 실리콘 기판위에 성장하는 기술 개발</li><li>- 페로브스카이트 증착이 가능하도록 실리콘 기판위에 버퍼층 개발</li><li>- 페로브스카이트 소재 벌크 세라믹 소재 합성</li><li>- 결정 배향 제어를 통한 압전박막 물성 제어</li><li>- XRD 분석을 이용한 단결정 박막의 구조 및 스트레스 분석</li><li>- P-E hysteresis curve, C-V measurement의 온도 의존성 분석</li></ul>	
<p>소속 부 서 : 전자재료연구단</p> <p>연수 책임자 : 백승협</p>	